PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-079050

(43) Date of publication of application: 12.03.1992

(51)Int.CI.

G11B 11/10

G11B 7/135

(21)Application number: 02-193457

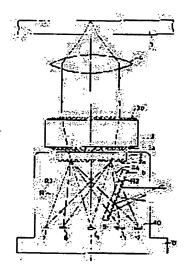
(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

20.07.1990

(72)Inventor: YOKOTA TAIZO

(54) OPTICAL PICKUP DEVICE FOR MAGNETO-OPTICAL RECORDING AND REPRODUCING DEVICE



(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify the adjustment of a light receiving system by integrating a light emitting means, first diffracting element, servo system photodetecting means, and reproducing system photodetecting means.

CONSTITUTION: This device is equipped with a semiconductor laser 1, first diffracting element to diffract reflected light from a magneto-optical disk 5 and to guide a ±1st-order diffracted light beam to the photodetecting means, third diffracting element 3, objective lens 4 and second diffracting element 6. The optical pickup device is equipped with light receiving elements 7 and 8 for tracking error

and focusing error and light receiving elements 11 and 12, for which polarizing plates 9 and 10 are respectively arranged on the incidental faces, for differentially detecting magneto-optical signal as light receiving systems. Then, the semiconductor laser 1, first

diffracting element 2, second diffracting element 6, light receiving elements 7 and 8, and light receiving elements 11 and 12 are housed in an LD-PD unit package 13 as an enclosure. Thus, the adjustment is simplified.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

· 19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-79050

審査請求

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成4年(1992)3月12日

(全13頁)

G 11 B 11/10 7/135 Z 9075-5D Z 8947-5D

•

未請求 請求項の数 5

54発明の名称 光磁気

光磁気記録再生装置における光ピツクアツブ装置

②特 願 平2-193457

②出 願 平2(1990)7月20日

@発 明 者 横 田

泰 浩

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 原 謙 三

明 細 書

1. 発明の名称

光磁気記録再生装置における 光ピックアップ装置

2. 特許請求の範囲

1. 発光手段から出射された直線偏光を光磁気記録媒体に照射して情報の記録を行い、光磁気記録媒体からの反射光に基づいて、フォーカス制御やトラッキング制御を行うと共に、カー効果を利用して光磁気信号を検出し情報の再生を行う光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置において、

格子ピッチが互いに異なる複数の回折領域を有する第1回折案子と、

光磁気記録媒体からの反射光が第1回折素子で回折されて生成された+1次回折光を受光することによって、フォーカスエラーおよびトラッキングエラーの検出に供される複数のサーボ系光検出手段と、

光磁気記録媒体からの反射光が第1回折索子で 回折されて生成された-1次回折光に基づいて、 光磁気信号の検出に供される複数の再生系光検出 手段と、

上記発光手段、第1回折索子、サーボ系光検出 手段、および再生系光検出手段とを一体化するための筐体とを備えていることを特徴とする光磁気 記録再生装置における光ピックアップ装置。

- 2. 上記筐体内に配設されると共に、上記-1次回折光のS偏光成分とP偏光成分とを自由な割合で透過させ、再生された光磁気信号のS/Nの調整に供される第2回折索子とを備えていることを特徴とする請求項第1項に記載の光磁気記録再生装置における光ビックアップ装置。
- 3. 上記第1回折索子は、格子ピッチが互いに 異なる2つの回折領域を有し、2分割された+1 次回折光に基づいてフォーカスエラーおよびトラッキングエラーを検出すると共に、2分割された -1次回折光に基づいて光磁気信号の差動検出を 行うことを特徴とする請求項第2項に記載の光磁

気記録再生装置における光ピックアップ装置。

4. 上記発光手段から出射された直線偏光の発 散光を平行光にするコリメートレンズ機能を有す る第3回折索子と、上記平行光を光磁気記録媒体 に集光させる集光手段とを備え、第3回折索子が 上記筺体に直接固定されていることを特徴とする 請求項第3項に記載の光磁気記録再生装置におけ る光ピックアップ装置。

5. 上記第3回折案子は、更に、上記発光手段から出射された直線偏光のファーフィールドバターンを補正する整形プリズムの機能をも有していることを特徴とする請求項第4項に記載の光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置。

3. 発明の詳細な説明

۲.

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光磁気記録再生装置が具備する光ピックアップ装置に関するものである。

〔従来の技術〕

光磁気配録によれば、情報は、垂直磁化膜等か

次に、光磁気ディスク107における反射光は 、カー効果によって、光磁気ディスク107の磁 化方向の違いに応じて偏光面が正負いづれか一方 に僅かに回転する。こうして光磁気ディスク10 7の情報を含んだ反射光は、対物レンズ106、 45°ミラー105を介じてハーフミラー104 に入射し、振動方向の特定された偏光がウォラス トンプリズム108に入射する。ウォラストンプ リズム108に入射した偏光は3分割され、スポ ットレンズ110、シリンドリカルレンズiT-1 を介して6分割された光検出器112に集光され る(整形プリズム103、ハーフミラー104、 およびウォラストンプリズム108は複合プリズ ム109を構成する)。そして、ウォラストンプ リズム108で3分割された光束のうち、中央の 光束によってフォーカスエラー信号およびトラッ キングエラー信号が得られ、両側の2本の光束に よって、光磁気信号が差動検出されるようになっ

前記した整形プリズム103の光強度分布の補

ら成る光磁気記録媒体において磁化方向の違いによって記録されている。その記録情報の再生には、光源の出射光の偏光面に対して、光磁気記録媒体における反射光の偏光面が磁化方向の違いに応じて互いに逆向きに回転する、いわゆるカー効果が利用される。光磁気記録再生装置は、磁化方向の違いに応じて検出された各再生信号を更に差動検出することによって情報の再生を行うものが一般的である。

正機能を第11図に基づいて説明する。尚、説明 の便宜上、第10図に示した部材と同一の機能を 有する部材には同一の符号を付記して、その説明 を省略する。第11図(a)に示される半導体レ ーザ101が出射する直線偏光は、半導体レーザ 101から十分離れたいわゆるファーフィールド パターンが楕円形になっている。コリメートレン ズ102を通過後の光束における楕円形の短軸長 をw 1 1、 長軸長をw 1 2 とする。 第 1 1 図 (a) に示すように、長軸長w12は整形プリズム1 03を通過後も変化しない。ところが、短軸長w 11は整形プリズム103によって長軸長w12 にまで拡張される。これは、整形プリズム103 の側面図としての第11図(b)に示すように、 wllの幅を有する平行光線束し、が、整形プリ ズム103の斜面に斜めに入射したのち屈折し、 w 1 2 の幅に拡張された平行光線束しょとなって 射出されるからである。これによって、ファーフ ィールドパターンは直径w2の真円に補正される。

しかしながら、上記の光ピックアップ装置では

、発光手段と受光手段の他に、各種機能を有する 光学部材を離散的に配設しているので、各部材の 位置調整及び固定に多大な時間を要する。 更に、 各部材を固定するハウジング等のひずみによる光 学的なずれを生じ、光ピックアップ装置の性能維 持が難しく、コストアップを招来する。

١,

そこで、部品点数を減らして小型化を図るものとして、特開平1-243257に開示された「 光ピックアップ」がある。

この光ピックアップ装置は、半導体レーザと記録媒体に光を集光する対物レンズとの間に設けられた回折格子と、多分割された1対のフォトクイオードの前面には、偏光方向の直交した偏光板が4年配置されている。そして、回折格子が記録媒体からの反射光を回折し、その±1次回折光がフォトのイオードによって受光され、光磁気信号が差動検出されるようになっている。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、特開平1-243257に開示され

なり、調整に時間を取られるという問題点を有し ている

又、特開平1-243257には、例えば、対 物レンズに導かれる半導体レーザの出射光を平行 光にするためのコリメートレンズあるいは同等機 能を有する部材についての記載がない。一般に、 光磁気ディスクに好適な光ピックアップ装置は、 コンパクトディスク用の光ピックアップ装置より も高開口数の対物レンズを傭えている。この様な 対物レンズをコリメートレンズ不要の有限系レン ズとして設計することは、収差を小さくする上で 困難を伴う。即ち、対物シンズを含めて受光系ま で全で一体化された光ピックアップ装置全体をフ ォーカッシング・トラッキング用アクチュエータ として使用するのであれば問題は無いといえるが 、特開平1-243257のように、対物レンズ のみをアクチュエータとして記録ピットに追従さ せようとすると、対物レンズの結像性能の保障範 囲が広くなるため、対物レンズを複数枚のレンズ 群で構成しなければならない。つまり、対物レン

た光ピックアップ装置では、光ディスクからの反 射光ピームが、4分割されたフォーカスエラー信 号検出用受光素子と 2 分割されたトラッキングェ ラー信号検出用受光素子とに、多分割受光素子で あるが故に、それぞれの受光センターに独立して 集光するように高精度の調整を行うことが不可欠 である。即ち、特開平1-243257に記載の 4分割受光索子は、フォーカスエラー検出のため に、受光面内における 2 軸方向の調整と、受光面 に垂直な光軸方向の調整(デフォーカスを取るた め)とを必要とする(但し、特開平1-2432 57には、フォーカス誤差を得るために必要な、 例えばシリンドリカルレンズのような非点収差発 生手段の記載がない。更に、デフォーカス調整用 に必要な平凹レンズについても記載されていない)。又、トラッキングエラー検出用の別体の2分 **割受光素子も、別体であるがゆえに、受光面に垂** 直な光軸方向の調整を必要とする。この結果、光 学系は簡略化して示されているものの、実際には 上記の調整を行うための調整用機構部品が複雑に

スの結像性能の保障範囲は、光軸方向(フォーカス方向)および光軸垂直方向(トラッキング方向)における全ての移動範囲に及ぶことになるのである。この結果、対物レンズが大型化して重くなるので、光ピックアップ装置の小型化および低コスト化を阻害するという問題点をも有している。

更に、特開平1-243257には、光ディスクに関射されて形成される光スポットの形状状を育まるための整形プリズムあるいは同等の半を育する部材についての記載がない。従来の企産のとでレーザビームの広がり角が異なるためにというの光スポットには非点収差が発生した。 光スポットの形状は真円にならない。 従来のでは、光ディスク上にレーザビームをより間では、光ディスク上にレーザビームをより問題では、光ディスク上にとができないという問題にある。

(課題を解決するための手段)

請求項第1項の発明に係る光磁気記録再生装置

における光ピックアップ装置は、上記の課題を解 決するために、発光手段たとえば半導体レーザか ら出射された直線偏光を光磁気記録媒体たとえば 光磁気ディスクに照射して惰報の記録を行い、光 磁気記録媒体からの反射光に基づいて、フォーカ ス制御やトラッキング制御を行うと共に、カー効 果を利用して光磁気信号を検出し情報の再生を行 う光磁気記録再生装置における光ピックアップ装 置において、格子ピッチが互いに異なる複数の回 折領域を有する第1回折案子と、光磁気記録媒体 からの反射光が第1回折素子で回折されて生成さ れた+1次回折光を受光することによって、フォ ーカスエラーおよびトラッキングエラーの検出に 供される複数のサーボ系光検出手段と、光磁気記 録媒体からの反射光が第1回折案子で回折されて 生成された-1次回折光に基づいて、光磁気信号 の検出に供される複数の再生系光検出手段と、上 記発光手段、第1回折索子、サーボ系光検出手段 、および再生系光検出手段とを一体化するための 筐体たとえばLD-PDユニットパッケージとを

ンズ機能を有する第3回折案子と、上記平行光を 光磁気記録媒体に集光させる集光手段とを備え、 第3回折案子が上記筺体に直接固定されているこ とを特徴としている。

請求項第5項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、上記の課題を解決するために、上記第3回折案子が、更に、上記発光手段から出射された直線偏光のファーフィールドパターンを補正する整形プリズムの機能をも有していることを特徴としている。

(作用)

請求項第1項の構成によれば、筐体内の発光手段から出射された直線偏光は、第1回折案子を透過し、光磁気記録媒体に導かれる。光磁気記録媒体に導かれる。光磁気記録は体で反射された反射光は、カー効果により記録情報に応じて、その偏光方向が上記直線偏光の偏光方向に対して、正負いづれか一方に僅かに回転する。格子ピッチが互いに異なる。反射光を行行のような反射光を生成する。上記回折領

備えていることを特徴としている。

請求項第2項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、上記の課題を解決するために、更に、上記筐体内に配設されると共に、上記~1次回折光のS偏光成分とP偏光成分とを自由な割合で透過させ、再生された光磁気信号のS/Nの調整に供される第2回折案子とを備えていることを特徴としている。

請求項第3項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、上記の課題を解決するために、更に、上記第1回折案子が、格子ピッチが互いに異なる2つの回折領域を有し、2分割された+1次回折光に基づいてフォーカスエラーおよびトラッキングエラーを検出すると共に、2分割された-1次回折光に基づいて光磁気信号の差動検出を行うことを特徴としている。

請求項第4項の発明に係る光磁気記録再生装置 における光ピックアップ装置は、上記の課題を解 決するために、更に、上記発光手段から出射され た直線偏光の発散光を平行光にするコリメートレ

域の格子ピッチがいさいたという。 主 1 次の格子ピッチがいさいて、複数のサーボ系光検との再生の一定を変数のサーボ系光検が、複数のサーボ系光検がののように変数のサーボを変数のサーボを変数のサーボを変数のサーボを変数のサーボを変数のサーボを変数のサーボを変数を受ける。 発達を受ける。 年代 という ラ 段 光 よい カカ らい ない カカ らい ない カラ の ない カラ ない から 素 いい の はい から まい の に 導く たい の の に はい の の と から まれる。

請求項第2項の構成によれば、筐体内に配設された第2回折案子は、光磁気記録媒体からの反射光が第1回折案子で回折されて生成された-1次回折光のS偏光成分とP偏光成分とを自由な割合で透過させる。これによって、例えば上記-1次回折光のカー回転角を増幅することができる。光

磁気信号のS/N値は、光検出手段が備えている
例えば受光素子の熱雑音やショットノイズが、 差動増幅信号のレベルに作用することに関係からず、そのDC成分に対するAC成分の変に対して作用することにも関係している。光光を向して作用することができるようである。というでは、 ステーロを増幅するための設計は、 光量をPと場所の反射光のカー回転角を θ * 、 光量をPと場所の関係を カー回転角を θ * 、 光量 Pと以下の関係を スノスカー回転角を θ * 、 光量 Pと以下の関係を スノスカー回転角 θ * 、 光量 Pと以下の関係を オードである。

 $S/N \propto 20 \log(P \sin 2 \theta_{k}) \sim 0$

又、光検出手段がアバランシェフォトダイオー ドである場合、以下のように示される。

S/N oc 2 0 log(P 1/2 sin 2 0 4) ... 2

このように、請求項第2項の発明に係る光ピックアップ装置では、第2回折素子は、上記①または②式に基づいて、-1次回折光のS偏光成分と P偏光成分の透過率を調整することによって反射

機能を有しているので、上記発光手段から出射された直線偏光の発散光を平行光にする。 集光手段は上記の平行光を光磁気記録媒体に小さく絞り込んで集光させることができる。

請求項第5項の構成によれば、上記第3回折案子が、更に、上記発光手段から出射された直線偏光のファーフィールドパターンを補正する整形プリズムの機能をも有しているので、集光手段にファーフィールドパターンが真円の平行光を導くことができる。これによって、集光手段は発光手段からの出射光を光磁気記録媒体に一層きれいに小さく絞り込んで集光させることができる。

〔実施例1〕

本発明の一実施例を第1図ないし第9図に基づいて説明すれば、以下の通りである。

本発明に係る光ピックアップ装置は、第1図に示すように、直線偏光を出射する発光手段としての半導体レーザ1と、光磁気記録媒体としての光磁気ディスク5からの反射光を回折し、±1次回折光を光検出手段に導く第1回折索子2と、コリ

光のカー回転角の増幅度を所定値に設定し、S/ Nを最適値とすることができるように構成されている。

請求項第3項の構成によれば、上記第1回折案子は、格子ピッチが互いに異なる2つの回折領域を有しているので、格子ピッチの相対的大小によって、名分割された+1次回折光と、2分割された+1次回折光とと生成する。そして、複数のサーボ系光してフェーカスエラーおよびトラシキングエラーの検出に供される。又、次回折光を第2回転来子を分して受光する。-1次の回折光のカー正領を対して受光する。-1次の回折光の力に受け、光磁気は、の記録媒体の記録情報に応じての位を表光できる。>/Nを更に向上させることができる。

請求項第4項の構成によれば、上記篋体に直接 固定されている第3回折案子はコリメートレンズ

メートレンズの機能を有する第3回折案子3と、 第3回折案子3からの平行光を光磁気ディスク5 に集光させる集光手段としての対物レンズ4と、 例えばP偏光成分をほぼ透過させ、S偏光成分を 任意の割合で屈折させる第2回折素子6とを備え ている。光ピックアップ装置は、更に、受光系と してトラッキングエラーおよびフェーカスエラー 検出用の受光素子7・8 (サーボ系光検出手段) と、入射面に偏光板9・10が各々配置され、光 磁気信号を差動検出するための受光素子11・1 2 (再生系光検出手段) とを備えている。半導体 レーザ1、第1回折索子2、第2回折案子6、受 光索子7・8、および受光案子11・12は、筐 体としてのしD-РDユニットパッケージ 1 3内 に収納されている。LD-PDユニットパッケー ジ13は、外界との遮蔽性に優れ、光ピックアッ プ装置の耐環境性を向上させることができる。

第3回折素子3は、半導体レーザ1側で光軸に 垂直な面、および光磁気ディスク5側で光軸に垂 直な面それぞれに、エッチングまたは切削によっ

第1回折索子2は、第3図に示すように、断面がそれぞれ矩形形状をなし、格子ピッチが相対的に小さい回折格子2aと格子ピッチが相対的に大きい回折格子2bとを有しており、回折格子2a2bの接合線2cが光磁気ディスク5のトラック方向(図中矢印下にて示す)に平行に設定され

、光スポットが分割線8c上に形成されるための調整は、まず、第3回折素子3のLD-PDユニットパッケージ13に対する粗調を、第3回折素子3における光軸に垂直な平面内で2軸方向に対して行った後、第1回折素子2の回転調整を行えばよい。これによって、受光系の調整時間は、従来よりも大幅に短縮される。

受光素子11・12における反射光の入射面に取り付けられた偏光板9・10は、第4図に示すように、偏光方向が互いに直交し、半導体レーザ1の出射光の偏光方向(図中矢印Pにて示す)に対して互いに逆向きに45°をなしている。

第2回折案子6は、第7図(a)に示すように、断面が矩形形状をなす回折格子を有し、第1回 折素子2と受光素子11・12との間の光路上に 配設されている。又、第2回折素子6の格子面と 受光素子11・12の受光面とがなす角度は、第 2回折素子6の回転調整によって可変となっており、後述するように、光磁気信号の生成に必要な 偏光成分(例えばP偏光成分)をほぼ100%透 ている。尚、第1回折案子2は回折格子2a 2 bが半導体レーザ1側に向けられ、LD-PDユニットパッケージ13の上面内側に固定されている。

組をなす受光素子7・8及び組をなす受光素子 11・12は、第5図に示すように、光磁気ディ スク5個から見て、半導体レーザ1の両翼にそれ ぞれ位置して配設され、受光素子8と受光素子1 1とが半導体レーザ1に近い側に位置するものと なっている。 受光素子8は、第3図に示すように 、トラック方向に対して若干傾きをなす分割線 8 cによって、受光部8aと受光部8bとに2分割 され、一種のナイフェッジ法の原理によってフォ ーカスエラー信号を生成する。又、受光素子?・ 8はトラッキングエラー信号の検出にも供される 。受光素子8の配設位置は、光スポットが分割線 8 c 上に形成されるように精度を必要とするが、 受光索子8以外の他の受光素子7・11・12の 配設位置は、光スポットが各受光面からはみださ ないという条件を満足するものであればよい。尚

過させて受光素子11・12に遅き、不要な偏光成分(例えばS偏光成分)を自由な割合で受光素子11・12以外の方向へ回折するようになっている。従って、良好な光磁気信号を得るためには、第2回折素子6の回転調整だけで充分であり、調整時間が節約できる構成となっている。

して第1回折案子2に導かれ、第1回折案子2の 回折格子2a・2bで回折される。

第2図及び第3図に示すように、第1回折案子 2の2つの回折領域のうち、格子ピッチが相対対 に小さい回折格子2aで生成された十1次回折格子2なで生成された光素子7上に 集光される。又、回折格子2aで生成された日 次回折光R2は、受光案子12に向けて相対的に 大きい回折格子2bで生成された十1次回折格子2bで生成された十1次回折格子2bで生成されたとと 3は、相対的に小さく回折され、受光素子8における受光された。 りる受光される。又、回折格子2bで生成された りないまた。 1次回折光R4も、 20折光R4も、 20折される。

受光部8a・8bの出力を各々A・B、受光素 子7の出力をCとすると、フォーカスエラー信号 FESは、一種のナイフエッジ法の原理に従って 、FES=A-Bの演算に基づいて生成される。 又、トラッキングエラー信号RESは、ブッシェ

動増幅器 1 9 の非反転入力端子に伝送され、出力 C は差動増幅器 1 9 の反転入力端子に伝送される 。これにより、差動増幅器 1 9 は A + B - C に対 応するトラッキングエラー信号 R E S を出力する。 次に、光磁気信号 M O (Magneto-Optical)の検

出方法を説明する。

 プル法に従って、RES=A+B-Cの演算に基 づいて生成される。更に、光磁気ディスク5にピ ット状の凹凸の形態で記録されているTOC情報 やセクタ番地等の情報を含むTOC信号RFは、 光の強弱に基づいてRF=A+B+Cの演算によ り検出され再生される。このような各種信号FE S・RES・RFを検出するための回路構成の一 例を第6図(a)に示す。受光部8a・8bの出 力をそれぞれA・B、受光素子1の出力をCとす る。出力A・B・Cはそれぞれコンデンサ14・ 15・16を介して直流分をカットされ、加算器 17で合成される。これにより、加算器17はA + B + C に対応する. T O C 信号 R F を出力する。 また、出力A・Bはそれぞれバッファアンプ、抵 抗を介し、出力Aは差動増幅器18の非反転入力 端子に伝送され、出力Bは差動増幅器18の反転 入力端子に伝送される。これにより、差動増幅器 18はA-Bに対応するフォーカスエラー信号F ESを出力する。更に、出力A·B·Cはそれぞ れパッファアンプ、抵抗を介し、出力A・Bは整

するので、差動増幅が可能である。

光磁気信号MOを検出する回路構成の一例を第6図(b)に示す。受光素子11・12の出力をそれぞれD・Eとする。出力D・Eはそれぞれバッファアンプ、抵抗を介し、出力Dは差動増幅器20の非反転入力端子に伝送され、出力Eは差動増幅器20の反転入力端子に伝送される。これにより、差動増幅器20はDーEに対応する光磁気信号MOを出力する。

以上のようにして、第2回折素子6の回転調整によって、カー回転角の増幅を最適なものにし、 光磁気信号のS/Nを向上させ、かつ、S/Nを 最適値に調整することができる。

(実施例2)

本発明の他の実施例を第8図および第9図に基づいて説明すれば、以下の通りである。

尚、説明の便宜上、前記の実施例の図面に示した部材と同一の機能を有する部材には、同一の符号を付記して、その説明を省略する。

本実施例に係る光ピックアップ装置を第8図(

a) (b) に示す。但し、第8図(b) は、第B 図(a)の側面図になっている。本実施例に係る 光ピックアップ装置は、前記の第3回折案子3の 代わりに、回折格子3 c・3 dを有する第3回折 紫子301を備えている。第3回折紫子301は 、半導体レーザーから出射された直線偏光の発散 光を平行光にするコリメートレンズ機能を有する と共に、半導体レーザ」から出射された直線偏光 のファーフィールドパターンを補正する整形プリ ズムの機能をも有している。 即ち、第3回折案子 301は、半導体レーザ1側で光軸に垂直な面、 および光磁気ディスク5側で光軸に垂直な面それ ぞれに、エッチングまたは切削によって形成され た回折格子3 c・3 dを有している。回折格子3 c · 3 d の各断面は、回折効率を上げるために鋸 歯状になっており、格子ピッチは中心から外周に 向かって徐々に小さくなっている。但し、回折格 子3cにおける鋸歯の各斜面は、第8図(a)(b) に示すように、第1実施例と同様に凸面をな . しているが、他方の回折格子3dにおける鋸歯の

各斜面は凹面をなしている。回折格子3 c の格子パターンは、第9図(a)に示すように、同心状の楕円形になっている。又、回折格子3 d の格子パターンは、第9図(b)に示すように、光磁気ディスク5 のトラック方向Tに平行な直線状になっている。

射されて形成される光スポットは真円となるので、再生信号量を増大させ、光磁気信号のS/Nを一層向上させることができる。

本発明に係る光ピックアップ装置は、以上のように、対物レンズ4以外の光学部品(第1回折素子2、第3回折案子3または第3回折案子301、第2回折案子6)を全て平板のガラス部材を用いて構成することが可能である。即ち、対物レンズ4以外の上記種々の機能を有する光学部品は、IC製造技術と同様に、平板ガラスに回折格子をエッチングする等により同時に大量に得られる。従って、ガラス部材を一品一品研磨する必要が無いので、量産に対応できる。

(発明の効果)

請求項第1項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、以上のように、格子ピッチが互いに異なる複数の回折領域を有する第1回折案子と、光磁気記録媒体からの反射光が第1回折案子で回折されて生成された+1次回折光を受光することによって、フォーカスエラー

およびトラッキングエラーの検出に供される複数のサーボ系光検出手段と、光磁気記録媒体からの反射光が第1回折案子で回折されて生成されたー1次回折光に基づいて、光磁気信号の検出を行う複数の再生系光検出手段と、上記発光手段、第1回折案子、サーボ系光検出手段、および再生系光検出手段とを一体化するための策体とを備えている構成である。

それゆえに、各光検出手段は、フォーカスエラー検出用光検出手段を除けば、多分割された受光面を必要としないので、光磁気記録媒体からの反射光を各光検出手段に導くための精度を要する調整は、筐体に取り付けられた第1回折案子の回転調整だけで済むようになり、受光系の調整を簡素化することができるという効果を奏する。

請求項第2項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、以上のように、上記箇体内に配設されると共に、上記-1次回折光のS偏光成分とP偏光成分とを自由な割合で透過させ、再生された光磁気信号のS/Nの調整に

供される第2回折案子とを備えている構成である。

それゆえに、光磁気記録媒体の記録情報に応じた上記ー1次回折光のカー回転角は、第2回折素子の位置調整によって増幅され、再生された光磁気信号のS/Nを向上させ、かつ、S/Nを最も望ましい値に調整できるという効果を奏する。

請求項第3項の発明に係る光磁気配録再生装置における光ピックアップ装置は、以上のように、上記第1回折索子は、格子ピッチが互いに異なる2つの回折領域を有し、2分割された+1次回折光に基づいてフォーカスエラーおよびトラッキングエラーを検出すると共に、2分割された-1次回折光に基づいて光磁気信号の差動検出を行う構成である。

それゆえに、光磁気記録媒体の記録情報に応じて正負の値をとるー1次回折光のカー回転角は、複数の再生系光検出手段の出力における位相を互いに反転させるので、これを利用して差動増幅することができ、光磁気信号のS/Nを更に向上させることができるという効果を奏する。

によって、構成部材が簡素化され、光ピックアップ装置の小型化を可能にすると共に、大径の平板ガラス上にエッチング等の技術によって、第1~第3回折案子を同時に多数枚製造することが可能なため、量産に対応できコストグウンに貢献する。更に、上記筐体を有することにより、外界との遮蔽度を高めることができ、耐環境性を向上させることができるという効果を併せて奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第7図は本発明の一実施例を示す ものである。

第1図は光ピックアップ装置の構成を示す概略 正面図である。

第2図は第1回折案子による±1次回折光の生成を示す説明図である。

第3図は第1回折案子と各受光素子との配置関係を示す説明図である。

第4図は再生系光検出手段としての受光素子の 前面に配置された偏光板の偏光特性を示す説明図 請求項第4項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、以上のように、上記発光手段から出射された直線偏光の発散光を平行光にするコリメートレンズ機能を有する第3回折案子と、上記平行光を光磁気記録媒体に集光させる集光手段とを備え、第3回折案子が上記像体に直接固定されている構成である。

又、請求項第5項の発明に係る光磁気記録再生装置における光ピックアップ装置は、以上のように、上記第3回折素子は、更に、上記発光手段から出射された直線偏光のファーフィールドパターンを補正する整形プリズムの機能をも有している構成である。

それゆえに、光磁気記録媒体に対する集光状態を良好なものにすることができる。特に、請求項第5項の発明に係る光ピックアップ装置においては、光磁気記録媒体に照射されて形成される光スポットの形状を真円にすることができ、、集光状態を一層良好なものにすることができる。更に、光学系に多機能の第1~第3回折素子を配すること

である。

第5図はLD-PDユニットパッケージにおける半導体レーザと各受光素子との配置関係を示す 説明図である。

第6図(a)はTOC信号RF、フォーカスエ ラー信号FES、およびトラッキングエラー信号 RESを検出する回路のブロック図である。

第6図(b)は光磁気信号MOを検出する回路のプロック図である。

第7図(a)は第2回折案子の動作を示す説明 図である。

第7図(b)はカー回転角の増幅を示す説明図 である。

第8図および第9図は本発明の他の実施例を示すものである。

第8図(a)は光ピックアップ装置の構成を示す概略正面図である。

第8図(b)は光ピックアップ装置の構成を示す概略側面図である。

第9図(a)は第3回折累子の上面に形成され

た回折格子の格子パターン、および上記回折格子 におけるファーフィールドパターンを示す説明図 である。

第9図(b)は第3回折案子の格子断面形状および動作を示す説明図である。

第9図(c)は第3回折素子の底面に形成された回折格子の格子パターン、および上記回折格子におけるファーフィールドパターンを示す説明図である。

第10図および第11図は従来例を示すものである。

第10図は光ピックアップ装置の構成を示す概略正面図である。

第11図(a)(b)は整形プリズムの動作を示す説明図である。

1 は半導体レーザ(発光手段)、2 は第1回折 案子、2 a・2 b は回折格子(回折領域)、3 は 第3回折案子、4 は対物レンズ(集光手段)、5 は光磁気ディスク(光磁気記録媒体)、6 は第2 回折案子、7・8 は受光素子(サーボ系光検出手 段)、 11・12 は受光素子 (再生系光検出手段)、 13 は b D - P Dユニットパッケージ (選体) である。

特許出願人

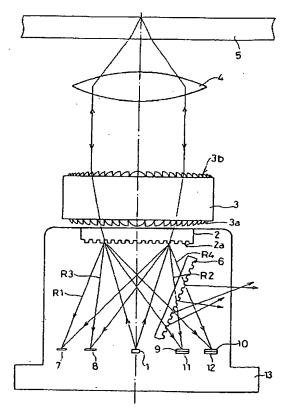
シャープ 株式会社

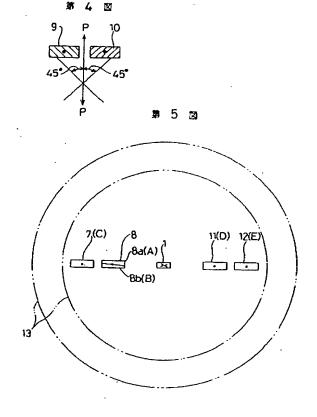
代理人 弁理士

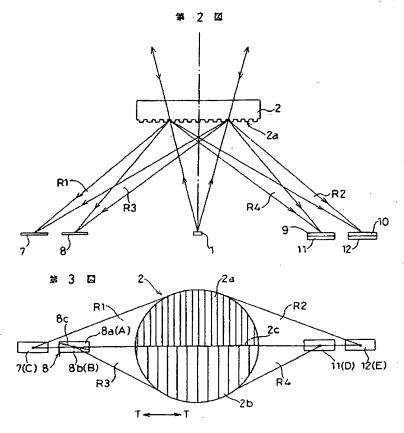
原 謙

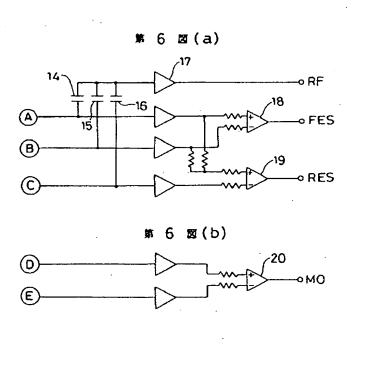


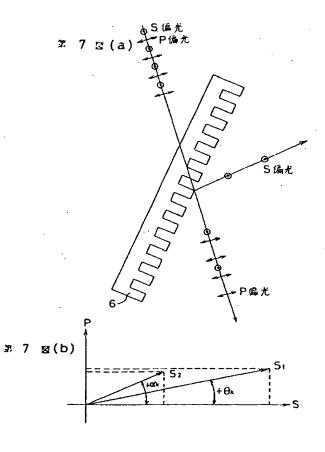
第 1 図

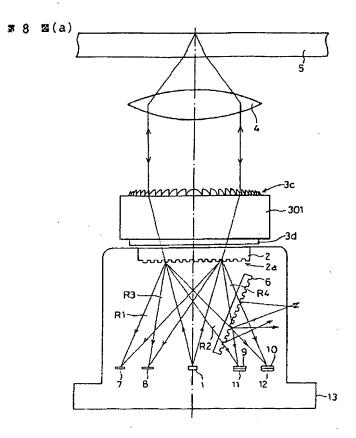


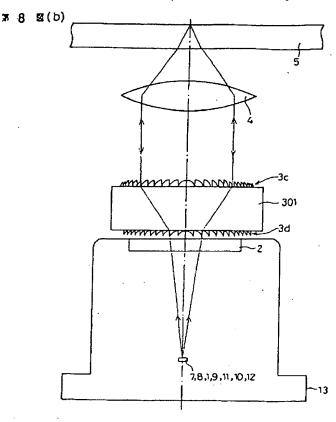


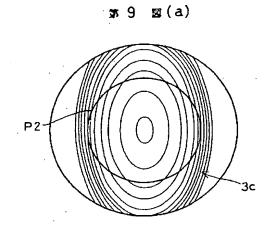


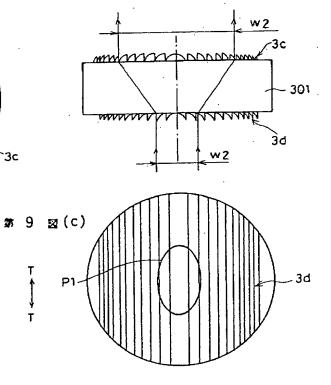






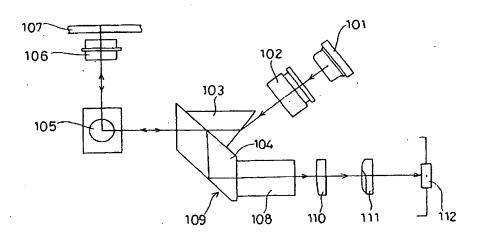




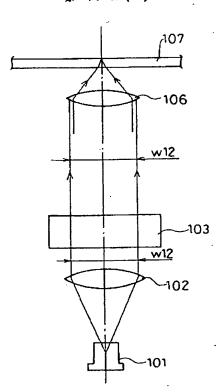


3 9 ₺ (b)

35 10 ⊠



第 11 図(a)



家 11 日(b)

